

## SECCIÓN H — SECCION H — ELECTRICIDAD

## H01 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS

## H01S DISPOSITIVOS QUE UTILIZAN LA EMISION ESTIMULADA

**Nota(s) [2]**

La presente subclase cubre:

- los dispositivos para la generación o la amplificación de las ondas electromagnéticas coherentes o de otros tipos de energía ondulatoria por emisión estimulada;
- las funciones como la modulación, la demodulación, el control o la estabilización de tales ondas.

**provide translation in ES ipc fixed texts.xml for id: subclass\_index**

|   |      |
|---|------|
| MASERES.....  | 1/00 |
| LASERES DE SEMICONDUCTOR.....                           | 5/00 |
| LASERES DE TIPOS DISTINTOS A LOS SEMICONDUCTORES .....  | 3/00 |
| OTROS DISPOSITIVOS QUE UTILICEN EMISION ESTIMULADA..... | 4/00 |

|             |  |        |   |
|-------------|--|--------|---|
| <b>1/00</b> | <b>Máser, es decir, dispositivos para la producción, amplificación, modulación, demodulación o cambio de frecuencia utilizando la emisión estimulada de ondas electromagnéticas más largas que las infrarrojas [1, 2006.01]</b>                              | 3/05   | . Construcción o forma de resonadores; Acomodación del medio activo en el interior de estos resonadores; Forma del medio activo [1, 2006.01]  |
| 1/02        | . sólidos [1, 2006.01]   | 3/06   | . . Construcción o forma del medio activo [1, 2006.01]  |
| 1/04        | . líquidos [1, 2006.01]  | 3/063  | . . . Láseres de guía de ondas, p. ej. amplificadores láser [7, 2006.01]  |
| 1/06        | . gaseosos [1, 2006.01]  | 3/067  | . . . . Láseres de fibra óptica [7, 2006.01]  |
| <b>3/00</b> | <b>Láser, es decir, dispositivos para la producción, amplificación, modulación, demodulación o el cambio de frecuencia utilizando la emisión estimulada de ondas infrarrojas, visibles o ultravioletas (láseres de semiconductor H01S 5/00) [1, 2006.01]</b> | 3/07   | . . . consistentes en una pluralidad de partes, p. ej. segmentos (H01S 3/067 tiene prioridad) [2, 7, 2006.01]   |
| 3/02        | . Detalles de estructura [1, 2006.01]  | 3/08   | . . Construcción o forma de resonadores ópticos o de sus componentes [1, 2, 2006.01]  |
| 3/03        | . . de tubos láser de descarga en el gas [2, 2006.01]  | 3/081  | . . . con más de dos reflectores [2, 2006.01]   |
| 3/032       | . . . para el confinamiento de la descarga, p. ej. por características particulares del tubo para la contracción de la descarga [5, 2006.01]   | 3/082  | . . . . definiendo una pluralidad de resonadores, p. ej. para la selección de modos [2, 2006.01]  |
| 3/034       | . . . Dispositivos ópticos situados en el interior del tubo o formando parte de él, p. ej. ventanas, espejos (reflectores con propiedades o posiciones variables para el reglaje inicial del resonador H01S 3/086) [5, 2006.01]                              | 3/083  | . . . . Láseres en anillo [2, 2006.01]  |
| 3/036       | . . . Medios para obtener o mantener la presión deseada del gas en el interior del tubo, p. ej. por medio de un getter o de una recarga; Medios para hacer circular el gas, p. ej. para uniformizar la presión en el interior del tubo [5, 2006.01]          | 3/086  | . . . teniendo uno o varios reflectores propiedades o posiciones variables para el reglaje inicial del resonador (haciendo variar un parámetro de la salida del láser durante su funcionamiento H01S 3/10; estabilización de la señal de salida del láser H01S 3/13) [2, 2006.01] |
| 3/038       | . . . Electrodo, p. ej. forma, configuración o composición particulares [5, 2006.01]   | 3/09   | . Procedimientos o aparatos para la excitación, p. ej. bombeo [1, 2006.01]  |
| 3/04        | . . Disposiciones para la refrigeración [1, 2006.01]   | 3/091  | . . utilizando el bombeo óptico [2, 2006.01]  |
| 3/041       | . . . para láser de gas [5, 2006.01]   | 3/0915 | . . . por luz incoherente [5, 2006.01]  |
| 3/042       | . . . para láser de estado sólido [5, 2006.01]   | 3/092  | . . . . producida por una lámpara de destellos (H01S 3/0937 tiene prioridad) [2, 5, 2006.01]  |
|             |  | 3/093  | . . . . . enfocando o dirigiendo la energía de excitación en el medio activo [2, 5, 2006.01]  |
|             |  | 3/0933 | . . . . . producida por un semiconductor, p. ej. un diodo emisor de luz [5, 2006.01]  |
|             |  | 3/0937 | . . . . . producida por la explosión de un material o por un material combustible [5, 2006.01]  |

- 3/094 . . . por luz coherente [2, 2006.01]
- 3/0941 . . . producida por un láser semiconductor, p. ej. un diodo láser [6, 2006.01]
- 3/0943 . . . producida por un láser de gas [5, 2006.01]
- 3/0947 . . . producida por un láser de colorante orgánico [5, 2006.01]
- 3/095 . . . utilizando el bombeo químico o térmico [2, 2006.01]
- 3/0951 . . . aumentando la presión en el medio gaseoso del láser [5, 2006.01]
- 3/0953 . . . Láseres de gas dinámico, es decir, con expansión del medio gaseoso del láser a velocidades de circulación supersónicas [5, 2006.01]
- 3/0955 . . . utilizando el bombeo por partículas de alta energía [5, 2006.01]
- 3/0957 . . . por partículas nucleares de alta energía [5, 2006.01]
- 3/0959 . . . por un haz de electrones [5, 2006.01]
- 3/097 . . . por descarga en el gas de un láser de gas [2, 2006.01]
- 3/0971 . . . excitado transversalmente (H01S 3/0975 tiene prioridad) [5, 2006.01]
- 3/0973 . . . teniendo una onda progresiva que atraviesa el medio activo [5, 2006.01]
- 3/0975 . . . utilizando una excitación inductiva o capacitiva [5, 2006.01]
- 3/0977 . . . con medios de ionización auxiliares [5, 2006.01]
- 3/0979 . . . Láseres de gas dinámico, es decir, con expansión del medio gaseoso del láser a velocidades de circulación supersónicas [5, 2006.01]
- 3/098 . . . Acoplamiento de modos; Supresión de modos (supresión de modos con la ayuda de una pluralidad de resonadores H01S 3/082) [2, 2006.01]
- 3/10 . . . Control de la intensidad, frecuencia, fase, polarización o de la dirección de la radiación, p. ej. conmutación, apertura de puerta, modulación o demodulación (acoplamiento de modos H01S 3/098) [1, 2, 2006.01]
- 3/101 . . . Láseres provistos de medios para cambiar el origen o la dirección de la radiación emitida [2, 2006.01]
- 3/102 . . . por control del medio activo, p. ej. por control de los procedimientos o de los aparatos para la excitación (H01S 3/13 tiene prioridad) [4, 2006.01]
- 3/104 . . . en los láseres de gas [4, 2006.01]
- 3/105 . . . por control de la posición relativa o de las propiedades reflectantes de los reflectores de la cavidad (H01S 3/13 tiene prioridad) [4, 2006.01]
- 3/1055 . . . estando constituido uno de los reflectores por una red de difracción [4, 2006.01]
- 3/106 . . . por control de un dispositivo situado en la cavidad (H01S 3/13 tiene prioridad) [4, 2006.01]
- 3/107 . . . utilizando un dispositivo electroóptico, p. ej. que producen un efecto Pockels o Kerry [4, 2006.01]
- 3/108 . . . utilizando un dispositivo óptico no lineal, p. ej. que producen una difusión por efecto Brillouin o Raman [4, 2006.01]
- 3/109 . . . Multiplicación de la frecuencia, p. ej. generación de armónicos [4, 2006.01]
- 3/11 . . . en los que el factor de calidad del resonador óptico es cambiado rápidamente, es decir, técnica de impulsos gigantes [1, 2006.01]
- 3/113 . . . con la ayuda de medios decolorantes o solarizantes [2, 2006.01]
- 3/115 . . . utilizando un dispositivo electroóptico [4, 2006.01]
- 3/117 . . . utilizando un dispositivo acústicoóptico [4, 2006.01]
- 3/121 . . . utilizando un dispositivo mecánico [4, 2006.01]
- 3/123 . . . Espejo giratorio [4, 2006.01]
- 3/125 . . . Prisma giratorio [4, 2006.01]
- 3/127 . . . Conmutadores de factor de calidad tipo "Q-switch" múltiples [4, 2006.01]
- 3/13 . . . Estabilización de parámetros de salida de láser, p. ej. frecuencia, amplitud [2, 2006.01]
- 3/131 . . . por control del medio activo, p. ej. por control de los procedimientos o aparatos para la excitación [4, 2006.01]
- 3/134 . . . en los láseres de gas [4, 2006.01]
- 3/136 . . . por control de un dispositivo situado en la cavidad [4, 2006.01]
- 3/137 . . . para estabilizar la frecuencia [4, 2006.01]
- 3/139 . . . por control de la posición relativa o de las propiedades reflectantes de los reflectores de la cavidad [4, 2006.01]
- 3/14 . . . caracterizados por el material utilizado como medio activo [1, 2006.01]
- 3/16 . . . Materiales sólidos [1, 2006.01]
- 3/17 . . . amorfos, p. ej. vidrio [2, 2006.01]
- 3/20 . . . Líquidos [1, 2006.01]
- 3/207 . . . incluyendo un quelato [5, 2006.01]
- 3/213 . . . incluyendo un colorante orgánico [5, 2006.01]
- 3/22 . . . gaseosos [1, 2006.01]
- 3/223 . . . siendo poliatómico el gas activo, es decir, conteniendo más de un átomo (H01S 3/227 tiene prioridad) [2, 5, 2006.01]
- 3/225 . . . incluyendo un "excimer" o "exciplex" [5, 2006.01]
- 3/227 . . . Vapor metálico [5, 2006.01]
- 3/23 . . . Disposiciones de varios láseres no previstas en H01S 3/02-H01S 3/14, p. ej. disposición en serie de dos medios activos separados (comprendiendo únicamente láseres de semiconductor H01S 5/40) [2, 7, 2006.01]
- 3/30 . . . utilizando efectos de difusión, p. ej. efecto Brillouin o Raman estimulado [2, 2006.01]
- 4/00 Dispositivos que utilizan la emisión estimulada de energía ondulatoria distinta a la prevista en los grupos H01S 1/00, H01S 3/00 o H01S 5/00, p. ej. máser fonón, máser gamma [1, 2006.01]**
- 5/00 Láseres de semiconductor [7, 2006.01]**
- Nota(s) [2010.01]**
- Es importante tener en cuenta la Nota (3) después del título de la sección C, dicha Nota indica a qué versión de la tabla periódica de elementos químicos se refiere la CIP. En este grupo, el sistema periódico usado es el sistema de grupo 8 se indica mediante números romanos en la Tabla Periódica en virtud del mismo.
- 5/02 . . . Detalles o componentes estructurales no esenciales en el funcionamiento del láser [7, 2006.01]
- 5/022 . . . Soportes; Encapsulados [7, 2006.01]
- 5/024 . . . Disposiciones para la refrigeración [7, 2006.01]

- 5/026 . . Componentes integrados monolíticamente, p. ej. guías de ondas, fotodetectores de monitorización, dispositivos para la excitación (estabilización de la salida del láser H01S 5/06) [7, 2006.01]
- 5/028 . . Revestimientos [7, 2006.01]
- 5/04 . Procesos o aparatos para la excitación, p. ej. bombeo (H01S 5/06 tiene prioridad) [7, 2006.01]
- 5/042 . . Excitación eléctrica [7, 2006.01]
- 5/06 . Disposiciones para controlar los parámetros de salida del láser, p. ej. actuando sobre el medio activo [7, 2006.01]
- 5/062 . . variando el potencial de los electrodos (H01S 5/065 tiene prioridad) [7, 2006.01]
- 5/0625 . . . en láseres con varias secciones [7, 2006.01]
- 5/065 . . Acoplamiento de modos ("mode locking"); Supresión de modos; Selección de modos [7, 2006.01]
- 5/068 . . Estabilización de los parámetros de salida del láser (H01S 5/0625 tiene prioridad) [7, 2006.01]
- 5/0683 . . . monitorizando los parámetros ópticos de salida [7, 2006.01]
- 5/0687 . . . Estabilización de la frecuencia del láser [7, 2006.01]
- 5/10 . Estructura o forma del resonador óptico [7, 2006.01]
- 5/12 . . teniendo el resonador una estructura periódica, p. ej. en láseres de realimentación distribuida [DFB] (H01S 5/18 tiene prioridad ) [7, 2006.01]
- 5/125 . . . Láseres de reflectores de Bragg distribuidos [DBR] [7, 2006.01]
- 5/14 . . Láseres de cavidad externa (H01S 5/18 tiene prioridad; acoplamiento de modos o "mode-locking" H01S 5/065) [7, 2006.01]
- 5/16 . . Láseres del tipo de ventanas, p. ej. con una región de material no absorbente entre la región activa y la superficie reflectora (H01S 5/14 tiene prioridad) [7, 2006.01]
- 5/18 . . Láseres de emisión superficial [SE] [7, 2006.01]
- 5/183 . . . que tienen una cavidad vertical [láseres-VCSE] [7, 2006.01]
- 5/187 . . . que utilizan un reflector de Bragg distribuido [láseres SE-DBR] (H01S 5/183 tiene prioridad ) [7, 2006.01]
- 5/20 . Estructura o forma del cuerpo semiconductor para guiar la onda óptica [7, 2006.01]
- 5/22 . . que tiene una estructura de tipo estriado o en forma de bandas [7, 2006.01]
- 5/223 . . . Estructura de banda enterrada (H01S 5/227 tiene prioridad) [7, 2006.01]
- 5/227 . . . Estructura de mesa enterrada [7, 2006.01]
- 5/24 . . que tiene una estructura ranurada, p. ej. con ranuras en V [7, 2006.01]
- 5/30 . Estructura o forma de la región activa; Materiales para la región activa [7, 2006.01]
- 5/32 . . que comprenden uniones PN, p. ej. heteroestructuras o dobles heteroestructuras (H01S 5/34, H01S 5/36 tiene prioridad) [7, 2006.01]
- 5/323 . . . en compuestos  $A_{III}B_V$ , p. ej. láser de AlGaAs [7, 2006.01]
- 5/327 . . . en compuestos  $A_{II}B_{VI}$ , p. ej. láser de ZnCdSe [7, 2006.01]
- 5/34 . . que comprenden estructuras de pozos cuánticos o de superredes, p. ej. láseres de pozo cuántico único [láseres SQW], láseres de pozos cuánticos múltiples [láseres MQW], láseres con heteroestructura de confinamiento separada que tienen un índice progresivo [láseres GRINSCH] (H01S 5/36 tiene prioridad ) [7, 2006.01]
- 5/343 . . . en compuestos  $A_{III}B_V$ , p. ej. láser de AlGaAs [7, 2006.01]
- 5/347 . . . en compuestos  $A_{II}B_{VI}$ , p. ej. láser de ZnCdSe [7, 2006.01]
- 5/36 . . que comprenden materiales orgánicos [2006.01]
- 5/40 . Disposición de dos o más láseres de semiconductor, no previstas en los grupos H01S 5/02-H01S 5/30 (H01S 5/50 tiene prioridad) [7, 2006.01]
- 5/42 . . Matrices de láseres de emisión superficial [7, 2006.01]
- 5/50 . Estructuras amplificadoras no previstas en los grupos H01S 5/02-H01S 5/30 [7, 2006.01]